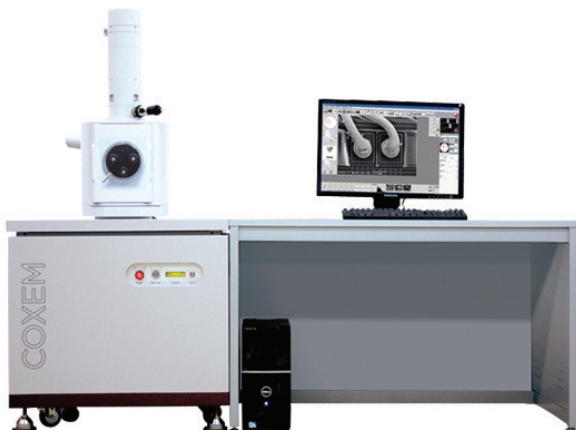


CX-200TM

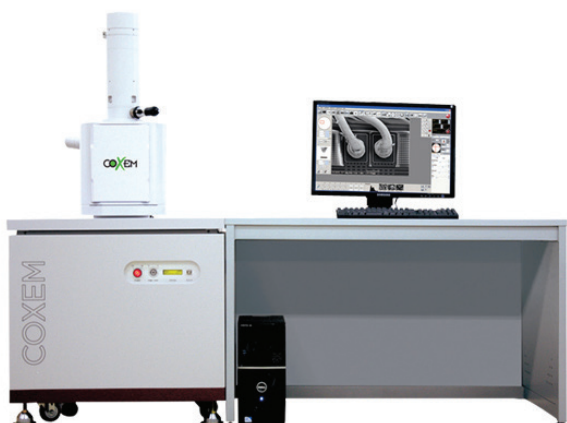


- Увеличение до x300 000
- Автоматические функции: настройка катода, фокусировка, контраст, яркость
- Изображение высокой чёткости: 5120 x 3840 пикселей

Технические характеристики

- Увеличение: x15 ~ x300 000 (эффективное: ~x100 000)
- Ускоряющее напряжение: 1 -30 кВ (с шагом 1 кВ)
- Электронная пушка: вольфрамовый филамент (W)
- Детекторы: SE, BSE (опционально)
- Столик: моторизированный столик (Z: 5 - 60)
- Столик с ручным приводом
- (X: 40 мм, Y: 40 мм, T: 20° - 90°, R: 360°)
- Смещение изображения: X, Y, R (вращение)
- Операционная система: Microsoft Windows 7
- Размеры: 800 (Ш) x 900 (Д) x 1500 (В) мм
- Вес: 400 кг

CX-200TA

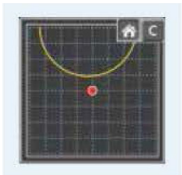


- Увеличение до x300 000
- Полностью моторизированный столик (X, Y, Z, R, T)
- Панорамный снимок
- Управление столиком мышью
- Автоматические функции: настройка катода, фокусировка, контраст, яркость
- Разрешение изображения: 5120 x 3840 пикселей

Технические характеристики

- Увеличение: x15 ~ x300 000 (полезное: ~x100 000)
- Ускоряющее напряжение: 1 -30 кВ (с шагом 1 кВ)
- Электронная пушка: вольфрамовый филамент (W)
- Детектор: SE, BSE, ЭДС (опционально)
- Столик: моторизированный
- (X: 40 мм, Y: 40 мм, T: 20° - 90°, R: 360°, Z: 5 - 60 мм)
- Смещение изображения: X, Y, R (вращение)
- Операционная система: Microsoft Windows 7
- Размеры: 800 (Ш) x 900 (Д) x 1500 (В) мм
- Вес: 400 кг

CX-200TA



Позиционирование

Пользователи могут с лёгкостью точно располагать образец на столике



Память параметров настройки катода:

В системе автоматически активируются и сохраняются параметры оптимального тока насыщения катода



Управление мышью

При использовании моторизации доступна функция управления столиком образцов с помощью мыши



Автофокус и точная фокусировка

Функция автофокуса облегчает работу оператора и позволяет получать более чёткие снимки даже при высоком увеличении

Панорамный снимок

Функция «панорамный снимок» позволяет автоматически объединять сканы отдельных участков в одно большое изображение. Оптимизирована для изучения больших участков поверхности с высоким разрешением, задача актуальна для исследования полупроводников, биологических образцов, металлов.

